

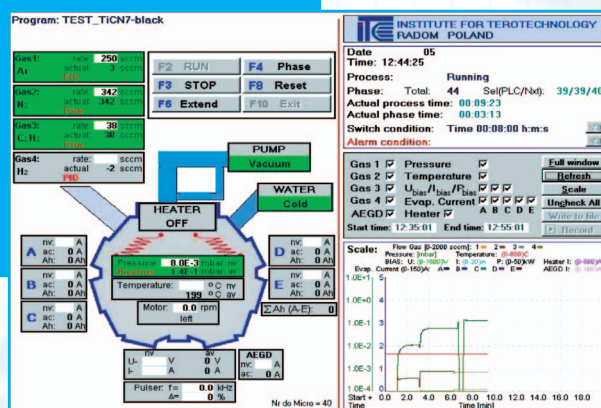
SYSTEM STEROWANIA PROCESAMI PLAZMOWEJ OBRÓBKI POWIERZCHNI

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

System sterowania procesami plazmowej obróbki powierzchni zapewnia automatyczne przeprowadzanie typowych procesów plazmowych stosowanych w inżynierii materiałowej. Przykładami obsługiwanych procesów jest azotowanie jarzeniowe, fizyczne nakładanie warstw z fazy gazowej z udziałem plazmy (PAPVD) metodą łukową oraz połączenie tych procesów dla jednego wsadu technologicznego.

System sterowania pozwala na pracę w trybie ręcznym z użyciem paneli operatorskich lub w trybie automatycznym za pomocą komputera PC.

System sterowania wyposażony jest w podsystemy stabilizacji wszystkich parametrów procesów. Sterowanie pozwala również na prowadzenie procesów z wykorzystaniem dodatkowej elektrody AEGD lub z wykorzystaniem dodatkowego grzania oporowego. Wszystkie moduły systemu połączone są przemysłową magistralą komunikacyjną, co umożliwia szybkie dostosowanie do wymagań danego procesu.



Okno wizualizacji przebiegu procesu

PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilania:	3 x 230/400 V/ 50 Hz
Obsługiwane źródła plazmy:	łukowe, magnetronowe, jarzeniowe
Inne układy zasilania:	zasilacze podłoży (stałoprądowe i impulsowe), zasilacze grzałek oporowych
Regulowane parametry procesów:	<ul style="list-style-type: none"> przepływ gazów technologicznych (4 szt.) niska, średnia i wysoka próżnia temperatura wsadu prędkość obrotowa pozycjonera wsadu
Metody regulacji:	PID, regulacja adaptacyjna
Monitorowanie i archiwizacja wszystkich parametrów procesów	
Automatyczne wykonywanie przepisów technologicznych	
Podsystem alarmów i ochrony operatora procesu	
Możliwość rozbudowy i adaptacji na potrzeby konkretnego procesu technologicznego	